⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-62278

@Int\_Cl\_4

識別記号

公 平

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月10日

H 04 N 5/335 H 01 L 27/14 6940-5C 7525-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 イメージセンサ

②特 顧 昭58-168252

❷出 願 昭58(1983)9月14日

**62発明者中井 敏** 

夫 川崎市幸区小向東芝町1

東京芝浦電気株式会社総合研究

砂発 明 者 鈴 木

川崎市幸区小向東芝町1

東京芝浦電気株式会社総合研究

所内

所内

79発明者 森

健 一 川崎市幸区小向東芝町

川崎市幸区小向東芝町1 東京芝浦電気株式会社総合研究

所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

砂代 理 人 弁理士 則近 憲佑

川崎市幸区堀川町72番地

外1名

明 網 概

1. 発明の名称

イメージセンサ

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 絶縁無板と、

前記絶縁性基板上に形成された下部電極と、

少なくとも前記下部電極上に形成された光電変換浴と、

前記光電影後層上に形成された透光性電極と、前記透光性電極及び光電変換層とを覆うように

形成された透明なシリコーン 樹脂層とを具備した ことを特徴とするイメージセンサ。

(2) 前記光報変換騰として非晶質シリコン脳を 用いたことを特徴とする特許線の範囲第1項記 載のイメージセンサ。

(3) 前記透光性電極として ITO 膜を用いたことを特徴とする特許額求の範囲第 1 項記載のイメージセンサ。

(4) 前記下総電極としてCrを用いたことを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載のイメージセン **ゅ**。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、光学的情報を電気信号に変換するイメージセンサに関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

イメーシセンサとしては従来から CCD を用いるもの等種々のものが知られている。近年、縮州小光学系等を用いず、原稿幅大の長尺型のイメーののような接尺型があると、縮小光学系等を用いると、縮小光学系等を用いると、縮小光学系等を用いることができる。長尺型のイメーでを少かを実現するための手段としては、例えて進むが開として、アモルファスを提供を用いるものがある。非品質半弱体を用いると、比較的容易に大面積の光能変換船を得ることができるため、有効な手段である。

第1図にアモルブアスシリコンを用いたイメー シセンサの一例を断面図として示す。

特勵階60-62278(2)

セラミックス等の基板(1)上にCr等の下部電極(2)が形成され、この上にアモルフアスシリコンの光 運変換層(3)が形成され、さらに ITO 膜の透明電極(4)が形成された構造をとる。このようなイメージ センサは透明福極(4)個から光が入射される。

ここで問題となるのは、イメージセンサの耐環境性の問題である。例えば第1 図に示したような構造のイメージセンサでは、耐湿性に問題があり、高湿度雰囲気中で暗電流が増加してしまう欠点がある。また、イメージセンサの光検知師は非常にデリケートであるため、ゴミの付着、楽品の侵入等による特性の劣化の問題もあつた。

このような問題に対し、例えば特開昭 5 7 - 141977 号にも開示されているように、光電変換装置をアクリル、ポリイミド樹脂でコーテイングして、信頼性の低下を防止する技術が知られている。

しかしながらこのような保護膜を形成しても、 なお実環境下での暗電流の増加等を防止するには 十分ではなかつた。

歪が生じ崎電旅が増加し、明暗化が低下してしま う。

また、選光性電極、光電変換層ともに Na\*, C8~イオン等のアルカリイオン、遊離ハロゲンイオンにより影響をうけやすく、特にその界面へた影響が大である。すなわち電極が阻界腐食されたり、イオンによるな流が暗電流に加わり、暗電流地増加でながる。シリコーン機能は Na\*, C6~イオンの含有度が少ないため、このクなイオンの含有度が少ない。 例えばアクラルスポーシ系等の場所を用いた場合、外部からなイオンが結局、外に阻止できるが、内部から生じたイオンが結局特性劣化に影響してしまう。

このように単に樹脂でコーテイングしただけでは、ストレスの影響、不純物イオンの影響により、かえつてイメージセンサの賭特性を劣化させてしまう。特に暗電流の増加等の悪影響は大なるものであり、シリコーン協能を用いることにより、このような特性劣化を生ずることなく、イメージセンサの耐限境性を向上させることができる。

(発明の目的)

本発明は以上の点を考慮してなされたものであり、特性を劣化させることなく耐環境性に優れたイメージセンサを提供することを目的とする。 (発明の概要)

本発明は、絶縁性素板と、前記絶縁性基板上に 形成された下部電極と、少なくとも前配下部電極 上に形成された光電変掛層と、前記透光性電極及び に形成された透光性電極と、前記透光性電極及び 光電変換層とを變うように形成された透明なシリ コーン樹脂層とを異備したことを特徴とするイメ ージセンサである。

このようにシリコーン樹脂でコーティングする ことにより、イメーシセンサの特性を劣化させる ことなく、耐環境性を大幅に向上させることがない きる。外部からの水分、異物、薬品等の侵入を阻 止できることはいうまでもないが、シリコーン樹 脂は被覆し、硬化させた場合に光電変換層に与え るストレスが小さい。よつて特性を劣化させるこ とがない。ストレスが大きいと、光電変換層等に

本発明において絶縁性基板としては、セラミックス,ガラス等が用いられる。またセラミックを用いた場合、多孔性であるので表面にグレーズ層を設け表面を平坦化したものを用いても良い。

下部電極としては、一般に用いられている A&, Cr, Ti, V, In 等各種金属を蒸費法、スパッタリング法等で設けたものが用いられる。この電極は光電変換層で変換された電気的量を検出するために設けられたものである。

光電変換層としては、光電を能荷量、導電率の変化等の数気的量に変換するものとして一般に知られているアモルファス Si(a-Si)。 アモルファス SiC、ポリ Si 等 無 機 感光材料およびメロシアス SiC、ポリ Si 等 無 機 感光材料およびメロシアス P リウム、スクアリウム等有機色素を用いたものや、ポルフイリン、ルテニウムトリスビビリシン錯体、酸化チタンとメテルピオロゲン等を用いた有機光導電材料等を使用することができる。

透光性関係としては一般に知られているオサ膜。 ITO膜,全群膜等の導電性を有し光が透過するも

特問時60~ 62278(3)

のを使用することができる。

光面整換層としては光応答性の点から a - Si を用いることが好ましい。また透光性電極としては a - Si との界面状態が良好な ITO 膜を用いることが好ましい。特に a - Si - ITO - Cr の組合 わせで用いた場合、良好な単位障壁が形成されるため、密積型として好適である。又、この場合、界面での湿度、不純物イオンの影響が大であるため、本発明の効果が顕著である。

また本発明のごとくいわゆるサンドイツチ構造

のイメージセンサで、審務モードで駆動する場合、 光電変換層は誘電体としても作用するが、不純物 イオン、起度等の影響で上下電極と光電変換層と の界面の運位障壁が不完全となると、暗電電視の増加等、審胎モードで駆動する場合の大きな問題と なる。しかしながら本発明では、このような影響 を防止できるため、書籍モードで使用する場合に 特に有効である。この場合下部軌極としては同じ く良好な電位障壁を形成するCrを用いることが好ましい。

## (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、イノージ センサの特性を劣化させることなく、耐環境他に 優れたイメージセンサを得ることができる。

## (発明の実施例)

本発明の実施例を以下説明する。

類2図は本発明光電変換案子の実施例を示す部分断面図である。

セラミック基板上にグレーズ脳を用いたもの又 はガラスを基板(I)として用いこの基板(I)上に Crを

蒸着し、PBP 法(フォトエングレイヴィンクプロセス)により直線状に配列された複数の電極(2)を形成する。続いて、この電極(2)を覆うごとくにSiH<sub>4</sub>ガスを原料としたプラズマ CVD 法により厚さ 1 #m 程度 = -Si: H からなる光電変換層(3)を設け、さらにこの光電変換層(3)上に ITO 膜をスパッター法又はスプレー法にて設け透光性電極(4)とする。さらにシリコーン樹脂(5)(東芝シリコーン製;TSE 3033)を前記透光性電極(4)、光電変換層(3)を複うように形成する。

このふうな構成をとるイメージセンサを用いて、 租益租限パイアス印加試験を行なつた(60℃, 程度90%, Crを正極として-1.5 V 印加)。

本務明の突飾例は7000時間経過後も暗電流の増加がなく、非常に優れた結果を得た。

比較として、ウレタン系、エポキン系、アクリル系の透明後脂を用いた場合についても同様の試験を行なつた。ウレタン系では、樹脂硬化後、泡を発生するもの、貴要してしまうもの、暗電流が増加してしまうもの等があつた。

またエポキシ系,アクリル系では硬化後、暗電流が増加してしまつた。この要因は硬化後の樹脂の収縮による機械的応力が光電変換層(3)と過光性電極との界面等に悪影響を及ぼすため、又、アルカリイオン等の樹脂からの不純物の侵入が影響を及ぼすために考えられる。

このように、本発明の効果はシリコーン樹脂を 用いたときにのみ、得られる効果であり、これは イメーシセンサ個有のものである。

また第3図に示すようにシリコーン樹脂(5)上に ガラス板(6)を配置した構成をとることもできる。 第3図は本発明の他の実施例を示す。イメージセンサの部分断面図である。ガラス板(6)を配置する 以外は第2図と同様の構成をとる。

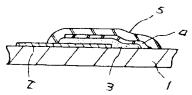
このような構成をとることにより、受光部の機械的強度が大きくなるこれはいうまでもないが、 シリコーン樹脂(5)だけの場合に比べ、静電気を起きにくいため、ゴミ等の付着が低減されかつ付着 したゴミを容易にとることができる。ガラス板は、 光学情報を変化させることのないように、いわゆ

持同昭60- G2278(4)

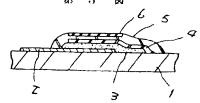
53 1 IS

7 3





# 3 ×



る光学ガラスを用いることが好ましい。

また、機器の小型化等のため、イメージセンサ 駆動用の例えばIC等の電気繁子を一枚の基板上に 実数し、センサ、回路を一体化して形成する。こ のとき、受光郎のみに光を入射するような魔部を 有する封止カバーでIC等をも一挙に封止する構成 をとれば、さらに受光部の劣化を抑止することが できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のイメージセンサの構造を示す部 分断面図。

第2回,第3回は本発明の実施例を示すイメージセンサの部分断面図。

1 … 絶縁性基板

2 …下部或杨

3 … 光電変換層

4 … 透光性電極

5 … シリコーン 樹脂

代理人 弁理士 助 近 覧 佑(ほか1名)